

CmController 6 Basic



El CmC 6 es un sistema de medición universal para la evaluación de la precisión de posicionamiento de los sistemas SMT. Su uso permite analizar y optimizar el comportamiento de la precisión del proceso de producción y detectar tempranamente las causas de los errores. El sistema consta de los componentes que se enumeran a continuación.

Unidad Base

Dimensiones (LxAxA): aprox. 620 x 600 x 1420 mm

Altura de trabajo: 1200 mm

Peso: aprox. 120 kg

Sistema de gantry/beam de dos ejes
Área de trabajo: aprox. 290 x 210 mm
Max. Tamaño de la tablilla de medición:
aprox. 350 x 240 mm

Montaje manual de las tablillas de medición por medio de barras magnéticas

Sistema de cámara con óptica telecéntrica y un tamaño de campo de visión de 6 x 5 mm

Iluminación de luz transmitida

Sistema de ruedas

Software de visión CmCVis2

Software de visión para llevar a cabo la medición.

- Algoritmos de correlación altamente precisos y robustos
- Mejora de la medición de ángulos en los componentes del chip

Capacidad de medición

La precisión de la medición se comprueba con una tablilla de medición calibrada del tipo MPL00 basada en la IPC 9850, que cumple los requisitos allí mencionados en cuanto a la capacidad y reproducibilidad del instrumento de medición para que se verifiquen los siguientes límites del proceso.

	Límites de proceso indicados	
Tarea de medición	x/y [μm]	theta [°]
TQFP100	10	0.20
0603 Chip	30	3.00
SOIC16	30	3.00



Visítanos en line en:
www.cetaq.com

CeTaQ GmbH - Dresden - GERMANY

Software Estadístico CmCStat6.0 Básico

Se utiliza para planificar, analizar y archivar las mediciones.

Adecuado para determinar la precisión de posicionamiento de los siguientes sistemas SMT:

- Montaje
- Dispensadoras

Trazabilidad los resultados de las mediciones garantizada mediante la documentación de las líneas y la configuración de la máquina en una base de datos

Diseño de una matriz de prueba individuales con disposición regular de los puntos de prueba

Uso de componentes de chips reales e ideales y componentes para calibración de vidrio.

Opciones para diferentes configuraciones de cabezal/boquilla/cámara para la planificación y evaluación de la prueba

Apoyo para encontrar las causas de las desviaciones
- Agrupación de valores medidos por beam/gantry, cabezal, ángulos, etc.

Amplia representación gráfica de los valores medidos

Cálculo de los parámetros de capacidad según el método del percentil

Apoyo a diferentes modelos de distribución

Fácil creación de reportes de las pruebas en formato PDF

Exportación de valores medidos como CSV

Medición de la velocidad

La velocidad de medición depende en gran medida del diseño de la prueba subyacente. Por esta razón, la siguiente información se refiere a una tablilla de medición calibrada del tipo MPL00 basada en la IPC 9850, que también se utiliza para probar la capacidad del instrumento de medición. Para la prueba se inicia el software de visión CmCVis2 y se define el punto cero de la placa de medición.

Plan de pruebas	Procedimiento	Número de componentes	Puntos de medición en FOV ¹	Tiempo de medición [min:seg]
TQFP100	Medición cuádruple	12	1	< 3:00
Patron/Grupo de chips	Medición cuádruple (campo de visión amplio)	128	16	< 2:00
Theta Chip	Medición cuádruple (campo de visión amplio)	56	1	< 3:00
Theta Chip	Cuádruple Medición (Campo de visión estrecho)	56	1	< 4:30

¹ Campo de visión



Visítanos en line en:
www.cetaq.com

CeTaQ GmbH - Dresden - GERMANY